

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(43) 国際公開日
2003年4月3日 (03.04.2003)

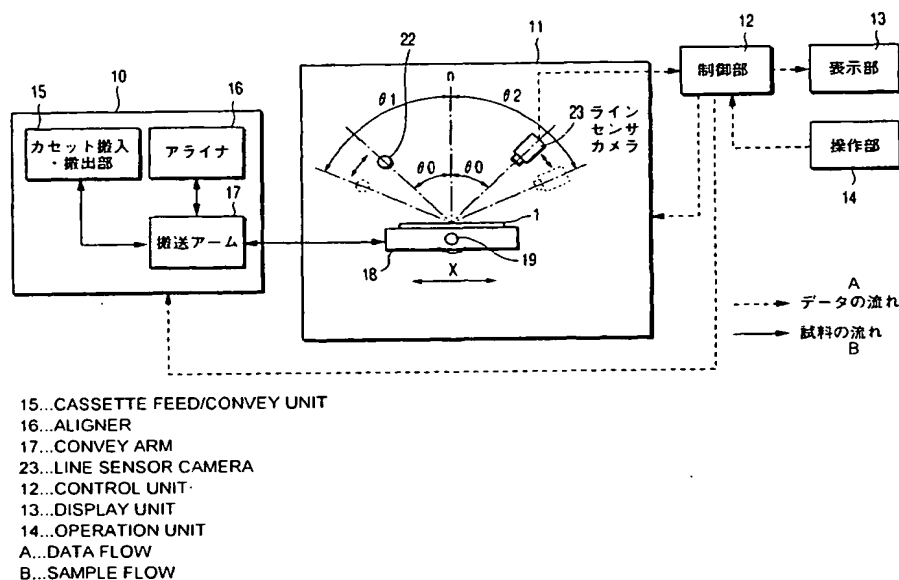
PCT

(10) 国際公開番号
WO 03/027652 A1

- (51) 国際特許分類⁷: G01N 21/956, H01L 21/66, 21/68
- (21) 国際出願番号: PCT/JP02/09762
- (22) 国際出願日: 2002年9月24日 (24.09.2002)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願2001-289963 2001年9月21日 (21.09.2001) JP
特願2002-80836 2002年3月22日 (22.03.2002) JP
- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): オリンパス光学工業株式会社 (OLYMPUS OPTICAL CO., LTD.) [JP/JP]; 〒151-0072 東京都渋谷区幡ヶ谷2丁目43番2号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者; および
(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 内木 裕 (NAIKI, Hiroshi) [JP/JP]; 〒396-0021 長野県伊那市伊那5755-1 NPライトコート伊那204号 Nagano (JP). 田中 利彦 (TANAKA, Toshihiko) [JP/JP]; 〒399-4106 長野県駒ヶ根市東町15-17 Nagano (JP).
- (74) 代理人: 鈴江 武彦, 外 (SUZUYE, Takehiko et al.); 〒100-0013 東京都千代田区霞が関3丁目7番2号 鈴榮特許綜合法律事務所内 Tokyo (JP).
- (81) 指定国 (国内): CN, DE, JP, KR, SG, US.
- 添付公開書類:
— 国際調査報告書
- 2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

(54) Title: DEFECT INSPECTION APPARATUS

(54) 発明の名称: 欠陥検査装置



(57) Abstract: A defect inspection apparatus includes moving means for rectilinearly moving a sample at a constant velocity at least in one direction at an inspection position, illumination means for illuminating a front surface and back surface of the sample moved by the moving means, image pickup means for picking up the entire front surface and the entire back surface of the sample illuminated by the illumination means and moved at the constant velocity, and defect inspection means for performing image processing of image data of the entire front surface and the entire back surface of the sample acquired by the image pickup means, so as to inspect whether the front surface and the back surface of the sample have any defect.

[続葉有]